# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.











## MicroPatent® PatSearch FullText: Record 1 of 1

Search scope: USG USA EPA EPB WO JP; Full patent spec.

Years: 1971-2001

Text: Patent/Publication No.: JP59218668

[no drawing available]

Download This Patent

Family Lookup

Citation Indicators



Go to first matching text

### JP59218668 A2 MAGNETIC DISK DEVICE **FUJITSU LTD**

Inventor(s): ;SAWADA SHIGETOMO ;HINOBAYASHI TAKEO Application No. 58093557 JP58093557 JP, Filed 19830526,

Abstract: PURPOSE: To suppress the evaporation and erasion of a lubricant film on the surface of a magnetic disk and always to maintain the lubricant film in the best lubricant state, by using a lubricant generating source which is exposed into the circulation of hot air current and produces the lubricant vapor.

CONSTITUTION: When a disk drive mechanism 5 is driven to give a high-speed revolution to a magnetic disk 1, a hot air current produced by a windage loss circulates as shown by arrows. Thus the temperature rises up inside an airtight container 7, and at the same time a member 10 impregnated with a lubricant is also heated. Thus the lubricant is evaporated. This lubricant vapor is transmitted through a filter 11 to get rid of dust, etc., and the clean lubricant steam is obtained. This clean vapor passes through a center venthole 3 drilled at the center of a hub mechanism 2 and flows among disks 1 through small ventholes 4 to be filled into an airtight container 7. Thus the balance is kept between the lubricant vapor pressure of the lubricant film on the surface of each disk 1 and the steam pressure generated by the increment of temperature. Thus it is possible to maintain at all times the lubricant film on the surface of the disk 1 in a steady state having good lubricant characterisitcs.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

Int'l Class: G11B01732: G11B00582





□ Include

Search

List

For further information, please contact:

Technical Suport | Billing | Sales | General Informat

9 日本国特許庁(JP)

40特許出顧公告

辍(B2) 13 特 許公

平1-21557

@Int\_CI\_4

广内整理器号

❷❷公告 平成1年(1989)4月21日

G 11 B

101

識別記号

M-8842-5D K-7627-5D

発明の数 1 (全3頁)

会発明の名称

眀

砂発

磁気ディスク装置

乳特 爾 昭58-93557 多公 第 昭59-218668

御田 頤 昭58(1983)5月26日 ❸昭59(1984)12月8日

伊発 明 者 沢田 茂 友

武

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社 内

6 野林 武 夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社

ØЖ 顧 宫士通株式会社 人 砂代 理 人

弁理士 井桁 <u>d</u> ---

官 審査 本 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

1

#### 切特許請求の範囲

1 ハブ機械部により一体に支持された磁気ディ スクが回転駆動機構に装着され、該磁気デイスク を気密収容容器により密封して成る装置構成にお いて、上記気密収容容器内に、磁気デイスクが回 5 (o) 従来技術と問題点 仮した際に融磁気ディスク面近傍で生ずる熱気流 の循環に曝されることにより潤滑剤蒸気を発生さ せる潤滑剤発生顔を配備してなることを特徴とす る磁気ディスク装置。

#### 発明の詳細な説明

#### (a) 発明の技術分野

本発明は磁気デイスク装置に係り、特に該装置 内に装着された磁気ディスクの表面に被覆してな る潤滑膜の潤滑特性を常に定常状態に維持し得る ようにした装置機成に関するものである。

#### (b) 技術の背景

近年、磁気デイスク装置においては、磁気ディ スクの磁性膜の薄膜化、或いは多層膜化及び磁気 ヘッドの低浮上化等によって高記録密度化が図ら えて更に停止時には磁気ヘッドが磁気デイスク面 上に接触した状態であり、回転速度の上昇と共に 該磁気ヘッドを微少に浮上させるようにした、所 謂CSS(Contact Start Stop) 方式の採用が進む 気ヘッド及び磁気ディスク表面に摩耗、損傷等の

ヘツドクラツシユが発生し易くなり、これを防止 する為、磁気デイスク表園に潤滑剤を塗布する か、或いは潤滑膜を被覆するなどの特別な表面処

理を施すことが一般に行われている。

2

ところで磁気デイスク装置の高記録密度化に伴 つて磁気ヘツドの低浮上化は益々重要となり、前 記磁気デイスク表面に施された潤滑膜も次集に薄 膜化されて、最近においては100人前後の傷めて 10 薄い、潤滑耐久性の優れた潤滑膜が要求されてい る。又一方前記CSS方式の採用により磁気デイス ク装置としては、塵埃の混入に起因するヘッドク ラツシユを防止するために、密封型に移行されつ つある。しかし、このような密封型磁気デイスク 15 装置にあつては、磁気デイスクの高速回転に伴う 風損によつて密封装置内の温度が上昇するため、 通常該内部の雰囲気を自己循環空冷方式によって 冷却しているが、それでもなお装置内が60~70℃ となる温度上昇は避けられず、かかる温度上昇に れている。そして上記磁気へツドの低浮上化に加 20 起因して磁気デイスク表面に施された潤滑腹が豪 発消失して、その潤滑特性が劣化する不都合があ り、このような不都合に対する耐熱性も要求され ている。

ところがこのような諸要求に対して、従来磁気 につれて、回動起動・停止時の接触摺動により磁 25 ディスク表面に潤滑膜を形成するに用いられてい る代表的な潤滑剤としては、例えばパラフィン、

高級脂肪酸族アルコール、高級脂肪酸エステル等 の炭化水素、又その弗化物であるフロロカーポン 系油、SiーSi結合基から成るシリコン系油等があ り、これら潤滑剤は単独、又は複合の形で用いら れているが、上記潤滑剤の内、炭化水素系の潤滑 剤、特に高級脂肪酸やそのエステル化物によつて 形成された潤滑膜は、潤滑特性が優れているた め、潤滑耐久性の向上に優れた効果があるが、そ の反面、60℃程度の雰囲気中において徐々に蒸発 る欠点がある。またフロロカーボン系油やシリコ ン系油等によって形成された潤滑膜は、耐熱性で は優れた特性を有しているが、潤滑特性が劣る 等、何れも一長一短の膜特性しか持合せていない 欠点がある。

従って、高記録密度化の為の測滑耐久性、耐熱 性に優れた超薄膜の潤滑膜を得ることが至難であ ることはもとより、このような潤滑膜を被覆形成 した磁気デイスクを密封型磁気デイスク装置に用 た高密度記録或いは再生を行うことが困難であつ た。

#### (d) 発明の目的

本発明は上記従来の欠点に鑑み、密封型磁気デ 滑膜の繁発消失を抑制して、該潤滑膜を常に良好 な潤滑特性を有する定常状態に維持し得る新規な 磁気デイスク装置を提供することを目的とするも のである。

#### (c) 発明の構成

そしてこの目的は本発明によれば、ハブ機構部 により一体に支持された磁気デイスクが回転駆動 機構に装着され、該磁気デイスクを気密収容容器 により密封して成る装置構成において、上記気密 気デイスク面近傍で生ずる熱気流の循環に曝され ることにより潤滑剤蒸気を発生させる潤滑剤発生 派を配備してなることを特徴とする磁気デイスク 装置を提供することによつて達成される。

#### (t) 発明の実施例

以下図面を用いて本発明の実施例について詳細 に説明する。

図面は本発明に係る磁気デイスク装置の一実施 例を概念的に示す要部断面図である。図におい

て、1は磁気ヘッドと対向する表面に図示しない 瀕潰膜を被覆して成る磁気デイスク、2は複数の 磁気デイスク1が一体に支持され、かつデイスク 回転駆動機構5に装着されたハブ機構、3はハブ 5 機構2の中心に穿設された中心通気穴、4は中心 通気大3と連通して各磁気デイスク1相互間に循 異雰囲気を流出させる通気小孔、 6 はヘッド位置 決め機構、7は気密収容容器、8はハブ機構2の 中心に穿設された中心通気穴3と連通するよう 消失して胸骨性を失つて行くといつた耐熱性が劣 10 に、ペース部8に設けられた循環雰囲気流通穴で あり、該流通穴8内には、例えば前記磁気デイス ク1が高速回転した際の風損によつて生ずる熱空 気流に曝されて容易に蒸発する潤滑剤を表面積の 大きいシリカゲル、或いはスポンジ等の多孔質部 15 材に含浸させた潤滑刺発生源、即ち間滑刺含浸部 材10と、該含浸部材10配置部分より矢印方向 側に図示のようにフイルタ11が配置されてい

しかして、このように磁気デイスク装置を構成 いた場合、ヘツドクラツシュ障害がなく、安定し 20 することにより、前記デイスク回転駆動機構 5 を 駆動して磁気デイスク1を高速回転した際の風損 によつて発生する熱空気流が図中矢印で示すよう に循環して前記気密収容容器 7 内の温度が上昇す ると共に、該循環熱空気流に曝された前記潤滑剤 イスク装置内に装着された磁気デイスク表面の潤 25 含浸部材10も加熱されて含浸した潤滑剤が蒸発 する。その潤滑剤蒸気はフイルター1において潤 滑剤等の粉塵、潤滑剤蒸気の大粒子等を排除して 清浄な潤滑剤蒸気とされ、ハブ機構2の中心に穿 設された中心通気穴3内を流通してそれと連通す 30 る各通気小孔4より各磁気ディスク1相互間に流 出される循環径路により気密収容容器了内に充満 される。

よって回転中の各磁気デイスク1表面の胸滑膜 を取り巻く前記測滑刺蒸気圧と、該潤滑膜が風損 収容容器内に、磁気デイスクが回転した際に該磁 35 による温度上昇に起因して蒸発する際の蒸気圧と が略平衡状態となり、その結果前記回転中の各礎 気ディスク1表面の御滑膜は常に良好な種滑特性 を有する定常状態に容易に維持することが可能と

> 尚、以上の実施例では潤滑剤発生源として、潤 40 滑剤を多孔質部材に含浸させた潤滑剤含浸部材を 用いた場合の例について説明したが、これに限定 されるものではなく、例えば潤滑剤を直接用いる ようにしてもよい。また上記した実施例にあつて

は、前記デイスク収容容器内の磁気デイスク表面 は勿論のこと、これ以外の機能部分にも潤滑剂が 被着されるが、当該潤滑膜は極めて薄いので装置 の機能を損なうことはない。更に前記ベース部に 設けられた循環雰囲気粒通穴内に、表面積の大き 5 の低浮上化、CSS方式等を採用した密封型磁気デ い合農性の良い多孔質部材を別に配設しておけ ば、気密収容容器内に充満される潤滑剤蒸気が必 要以上に過剰となつた場合に、該部材に吸収させ て蒸気量の調節と安定化を図ることも可能であ **る。** 

#### (8) 発明の効果

以上の説明から明らかなように、本発明に係る 磁気デイスク装置の構造によれば、簡単な改良機 成により、装置内に装着され、かつ回転駆動中の 磁気デイスク表面の潤滑膜の蒸発消失が抑制さ れ、該閥滑膜が常に良好な潤滑特性を有する定常 状態に維持することができる利点を有する。依つ てこの種の磁気デイスク装置、或いは磁気ヘツド イスク装置などに適用して極めて有利である。

#### 図面の簡単な説明

図面は本発明に係る磁気ディスク装置の一実施 例を概念的に示す要部断面図である。

図面において、1は潤滑膜が被覆された磁気デ イスク、2はハブ機構、3は中心通気穴、4は通 気小孔、5はデイスク回転駆動機構、7は気密収 容容器、8は循環雰囲気流通穴、9はペース部、 1Dは潤滑剤含慢節材、11はフイルタを示す。

